

# WFM-MU

Geschliffene und feingeschliffene Optiken werden vor dem Polieren taktill gemessen. Flächig, d.h. z.B. mit einem Interferometer, ist dies derzeit nicht möglich. Die absolute Messunsicherheit taktiler Messungen liegt im  $\mu\text{m}$ -Bereich, auch wenn geringere Auflösungen angegeben werden. Das Abtasten benötigt je nach Punktdicke auch schon mal 30 min. Die Daten werden für die anschließende Korrektur-Politur verwendet. Bei einer Genauigkeit der Form von 0,01  $\mu\text{m}$  sind mehrere Iterationen üblich.

## Eckdaten

### Forschungsschwerpunkt

Sustainable Production & Energy Technologies

### Laufzeit

01.01.2018 - 31.12.2020

### Fördergeber

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst

### Projektleitung

Prof. Dr. rer. nat. Gerald Fütterer

## Ziele

Ziel des Projektes ist es, mehrere wichtige Messprobleme der Präzisions-Optik-Fertigung zu lösen. Dazu soll ein Messkonzept in eine Messmethode und in ein Messsystem überführt werden. Das Messsystem soll in der Lage sein, asphärische Optiken und Freiform-Optiken zu messen. Darüber hinaus soll dies im geschliffenen und fein-geschliffenen Zustand möglich sein. Die Messzeit und die Mess-unsicherheit bestehender taktiler Systeme sollen erheblich reduziert werden.